



Учредители:

Министерство
образования и науки
Российской Федерации

Национальный
исследовательский
университет «МИЭТ»

Главный редактор

Чаплыгин Ю.А., академик РАН,
д.т.н., проф.

Зам. главного редактора
Гаврилов С.А., д.т.н., проф.

Редакционная коллегия:

Бархоткин В.А., д.т.н., проф.

Бахтин А.А., канд. т. н., доц.

Быков Д.В., д.т.н., проф.

Горбачевич А.А., чл.-корр. РАН,
д.ф.-м.н., проф.

Грибов Б.Г., чл.-корр. РАН,
д.х.н., проф.

Казённов Г.Г., д.т.н., проф.

Коноплёв Б.Г., д.т.н., проф.

Коркишко Ю.Н., д.ф.-м.н., проф.

Королёв М.А., д.т.н., проф.

Красников Г.Я., акад. РАН,
д.т.н., проф.

Кубарев Ю.В., д.ф.-м.н., проф.

Лабунов В.А., акад. НАН Беларусь,
акад. РАН, д.т.н., проф.

Максимов И.А., PhD, проф.
Лундского университета
(Швеция)

Меликян В.Ш., чл.-корр. НАН Армении,
д.т.н., проф.

Неволин В.К., д.ф.-м.н., проф.

Неволин В.Н., д.ф.-м.н., проф.

Петросянц К.О., д.т.н., проф.

Сазонов А.Ю., PhD, проф.
Университета Ватерлоо
(Канада)

Сауров А.Н., акад. РАН, д.т.н., проф.

Селищев С.В., д.ф.-м.н., проф.

Сигов А.С., акад. РАН,

д.ф.-м.н., проф.

Таиров Ю.М., д.т.н., проф.

Телец В.А., д.т.н., проф.

Тимошенков С.П., д.т.н., проф.

Усанов Д.А., д.ф.-м.н., проф.

Известия высших учебных заведений ЭЛЕКТРОНИКА

Том 22 № 4

2017 июль–август

Научно-технический журнал

Издается с 1996 г.

Выходит 6 раз в год

СОДЕРЖАНИЕ

Технологические процессы и маршруты

Белов А.Н., Перевалов А.А., Шевяков В.И. Мемристорные структуры для микро- и наноэлектроники. Физика и технология. Обзор 305

Вигдорович Е.Н. Механизм формирования квантово-размерных слоев гетероструктур AlGaN/GaN/InGaN/GaN ... 322

Волоховский А.Д., Герасименко Н.Н., Петраков Д.С. Применение комбинированных оптических методов для контроля процесса травления щелевой изоляции 331

Рябышленков А.С. Термодинамический анализ процесса воздухоподготовки чистых помещений 341

Элементы интегральной электроники

Сергеев В.А., Теменъкин Я.Г. Оценка адекватности тепловой модели КМОП цифровых интегральных схем по переходным тепловым характеристикам 350

Кононов В.С., Шелепин Н.А. Повышение эффективности моделирования переходных процессов в КМОП-микросхемах с учетом одиночных радиационных эффектов 361

Схемотехника и проектирование

Гаврилов С.В., Карева Е.С., Рыжкова Д.И. Алгоритмы логико-топологического синтеза библиотечных элементов и блоков с регулярной структурой для технологических норм проектирования 32 нм..... 369

Заведующая редакцией С.Г. Зверева	Булах Д.А., Казённов Г.Г., Лапин А.В. Использование модификации алгоритма работы сетей Петри для функционального моделирования логических схем, представленных на вентильном уровне	379
Редактор А.В. Тихонова	Микро- и наносистемная техника	
Научный редактор С.Г. Зверева	Аунг Тхура, Симонов Б.М., Тимошенков С.П. Влияние параметров конструкции актиоаторов на чувствительность частотных микроакселерометров	386
Корректор И.В. Проскурякова	Краткие сообщения	
Верстка А.Ю. Рыжков С.Ю. Рыжков	Кондратьев П.К. Методика регулирования концентрации углеродных нанотрубок при формировании композитной металлизации ИС	398
Адрес редакции: 124498, Россия г. Москва, г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, МИЭТ Тел.: 8-499-734-6205 E-mail: magazine@miet.ru http://www.miet.ru	Тимошенков В.П., Фатеев И.А. DICE КМОП КНИ-триггер, устойчивый к воздействию тяжелых заряженных частиц для применения в приемных трактах	402
	К сведению авторов	407

Подписано в печать 31.07.2017.

Формат бумаги 60×84 1/8.

Цифровая печать.

Объем 12,6 усл.печ.л.,

11,136 уч.-изд.л.

Тираж 150 экз.

Заказ 14.

Свободная цена.

Отпечатано

в типографии ИПК МИЭТ

124498, Россия, г. Москва,

г. Зеленоград, пл. Шокина, д. 1, МИЭТ

Свидетельство о регистрации

№ 014134

выдано Комитетом РФ по печати

12.10.95.

Включен в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук.

Включен в Российский индекс научного цитирования и в Рейтинг Science Index.

Включен в Russian Science Citation Index на платформе Web of Science.

Proceedings of Universities. ELECTRONICS

**Volume 22 №. 4
2017 July–August**

Founders:

**The Ministry
of Education and Science
of the Russian Federation**

**The National
Research University
of Electronic Technology**

Editor-in-Chief

**Chaplygin Yu.A., Dr. Sci. (Tech.),
Prof., Acad. RAS**

The scientific-technical journal

Published since 1996

Published 6 times per year

Deputy Editor-in-Chief

**Gavrilov S.A., Dr. Sci. (Tech.),
Prof.**

Editorial Board:

Barkhotkin V.A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Bahtin A.A., Cand. Sci. (Tech.)
Bykov D.V., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
**Gorbatshevich A.A., Dr. Sci. (Phys.-Math.),
Prof., Cor. Mem. RAS**
Gribov B. G., Dr. Sci. (Chem.), Prof.
Kazennov G.G., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Konoplev B.G., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Korkishko Yu.N., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
Korolev M.A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
**Krasnikov G.Ya., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,
Acad. RAS**
Kubarev Yu.V., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
**Labunov V.A. (Belorusia),
Dr. Sci. (Tech.), Prof.,
Acad. NAS, Acad. RAS**
**Maksimov I.A. (Sweden), PhD, Prof.
of Lund University**
**Melikyan V.Sh. (Armenia), Dr. Sci. (Tech.),
Prof., Cor. Mem. NAS**
Nevolin V.K., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
Nevolin V.N., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
Petrosyant K.O., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
**Sazonov A.Yu. (Canada), PhD,
Prof. of University of Waterloo**
**Saurov A.N., Dr. Sci. (Tech.), Prof.,
Acad. RAS**
Selishchev S.V., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.
**Sigov A.S., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.,
Acad. RAS**
Tairov Yu.M., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Telets V.A., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Timoshenkov S.P., Dr. Sci. (Tech.), Prof.
Usanov D.A., Dr. Sci. (Phys.-Math.), Prof.

CONTENTS

Technological processes and routes

Belov A.N., Perevalov A.A., Shevyakov V.I. Physics-Technological Fabrication of Memresistors for Micro- and Nanoelectronics. Review	305
Vigdorovich E.N. Mechanism of Forming of Quantum-Size Layers of AlGaN/GaN/InGaN/GaN Layers	322
Volokhovskiy A.D., Gerasimenko N.N., Petrakov D.S. Application of Optical Combined Methods to Control of Shallow Etching Process	331
Ryabyshenkov A.S. Thermodynamic Analysis of Process of Clean Rooms Air Handling	341

Integrated electronics elements

Sergeev V.A., Tetenkin Ya.G. Assessment of Adequacy of the CMOS Linear Thermal Model of Digital Integrated Circuits on Transient Thermal Characteristics	350
Kononov V.S., Shelepin N.A. An Increase of Efficiency in Modeling Transient Processes in CMOS-Microchips Considering Single Radiation Effects	361

Circuit engineering and design

Gavrilov S.V., Kareva E.S., Ryzhova D.I. Algorithms of Logical and Physical Synthesis of Library Elements with Regular Structure for Design Rules 32 nm	369
--	-----

Head of editorial staff
Zvereva S.G.

Chief editors
Tikhonova A.V.,
Proskuryakova I.V.

Make-up
Ryzhkov S.Yu.
Ryzhkov A.Yu.

Address: 124498, Russia, Moscow,
Zelenograd, Bld. 1, Shokin Square,
MIET, editorial office of the Journal
«Proceedings of Universities. Electronics»
Tel.: +7-499-734-62-05
E-mail: magazine@miee.ru
http://www.miet.ru

Signed to print 31.07.2017.

Sheet size 60x84 1/8.

Digital printing.

Conventional printed sheets 12,6.

Number of copies 150.

Order no. 14.

Free price.

The journal is printed at the printing workshop of the MIET
124498, Russia, Moscow, Zelenograd,
Bld. 1, Shokin Square, MIET

The registration certificate No.014134 was given by RF Press Committee on 12.10.95.

The journal is included into the List of reviewed scientific publications, in which the main scientific results of thesis for candidate of science and doctor degrees must be published.

The journal is included into the Russian index of scientific citing and into the Rating Science Index.

The journal is included into the Russian Science Citation Index on the Web of Science basis.

Bulakh D.A., Kazennov G.G., Lapin A.V. Use of Modification of Petri Nets Operation Algorithm for Functional Simulation of Gate Level Digital Circuits 379

Micro- and nanosystem technology

Aung Thura, Simonov B.M., Timoshenkov S.P. Influence of Parameters of Actuators Constructions on Sensitivity of Frequency Microaccelerometers 386

Brief reports

Kondratiev P.K. Controlling of Carbon Nanotubes Concentration in VLSI Metallization Based on Metal Matrix – CNT Composite Conductors 398

Timoshenkov V.P., Fateev I.A. DICE Flip Flop Trigger Tolerant to Effect of Heavy Charged Particles 402